(54) MICROCAPSULE AN TS PREPARATION (19) JP

(11) 63-137746 (A) .6.1988

(21) Appl. No. 61-286229 (22) 1.12.1986 (71) LION CORP (72) MASAHIRO TAKIZAWA(1)

(51) Int. Cl<sup>1</sup>. B01J13/02,A01N25/28,A61K7/00,A61K9/50,C11D17/08,C12N11/08

PURPOSE: To easily control the particle size of a microcapsule, by encapsulating a core substance, which is obtained by compounding a water-soluble or water absorbable polymer and at least one kind of a substance selected from among salts, polyhydric alcohol and a surfactant with an effective component, with a semipermeable wall film.

CONSTITUTION: After a solution containing a semipermeable wall film forming high-molecular compound is prepared, an aqueous core substance composition containing at least one kind of a polymer (A) selected from among a water-soluble polymer and a water absorbable polymer and at least one kind of a component (B) selected from among salts, polyhydric alcohol and a surfactant is dispersed in said solution along with an effective component. Subsequently, a non-solvent or a phase separation inducing agent is added to said composition to prepare a microcapsule wherein a semipermeable wall film is formed to the periphery of the core substance. As the aforementioned water-soluble polymer, cellulose ether is designated and, as the water absorbable polymer, a polyacrylic acid resin is designated.

(54) METHOD FOR START-UP OF REACTION SYSTEM

(11) 63-137747 (A) (43) 9.6.1988 (19) JP

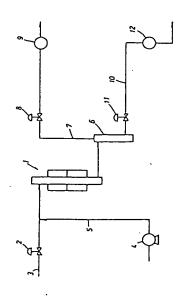
(21) Appl. No. 61-286255 (22) 1.12.1986

(71) CHIYODA CHEM ENG & CONSTR CO LTD (72) SEIJI KODAMA(2)

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. B01J19/00

PURPOSE: To simplify start-up and to shorten the time, by a method wherein the pressure and flow rate in a reactor are stabilized and, after the coincidence with the theoretical value of material balance is judged, the temp. in the reactor is controlled.

CONSTITUTION: A gaseous phase raw material substance is introduced into a catalytic reactor 1 through a pipeline 3 and a flow control valve 2 while a liquid phase raw material substance is similarly supplied to the reactor 1 through a pipeline 5 by a pump 4. These raw material substances react in the catalytic reactor 1; the formed substance is taken out to a gas-liquid separator 6 and the formed substance in a gaseous phase state is taken out to the outside through a pipeline 7, a pressure control valve 8 and a flowmeter 9. The liquid phase product obtained in the gas-liquid separator 6 is taken out to the outside through a pipeline 10, a liquid controller 11 and a flowmeter 12. Further, when material balance is stabilized, previously, not only the material balance but also temp. stabilization can be achieved in relatively surely.



(54) GAS DISCHARGE REACTION APPARATUS

(11) 63-137748 (A) (43) 9.6.1988 (19) JP

(21) Appl. No. 61-286306 (22) 1.12.1986

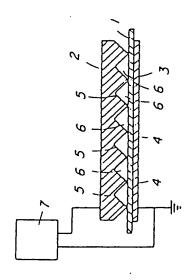
(71) EBARA RES CO LTD(2) (72) HIROICHI SHIODA

(51) Int. Cl4. B01J19/08

PURPOSE: To miniaturize a gas discharge reaction apparatus and to promote discharge reaction, by applying alternating high voltage between a conductive electrode plate and a counter electrode plate and allowing raw material gas

to pass through a passage.

CONSTITUTION: In applying alternating high voltage across an electrode plate 2 and an opposed electrode 3, relatively low voltage is applied at first and said voltage is made gradually high. Hereupon, discharge begins in the vicinity of a contact part 4 and, as the voltage applied is allowed to rise, a discharge area increases at a place remote from the contact part 4 and a passage 6 is perfectly filled with strong discharge at a certain threshold value. This discharge is one wherein a silent discharge area and a creeping discharge area are mixed; by the continuation and fusion of both discharge area, the creeping discharge area having high discharge density generated in the vicinity of the contact part 4 is enlarged on the side of a non-contact part 5 and the discharge density in the passage 6 is made high as a whole.



. ⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭63-137748

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号 B-6639-4G

母公開 昭和63年(1988)6月9日

B 01 J 19/08

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

気体放電反応装置

②特 顋 昭61-286306

型出 願 昭61(1986)12月1日

砂発 明 者

塩 田

博一

東京都港区南青山5丁目4番27-802号

砂出 願 人

株式会社荏原総合研究

神奈川県藤沢市藤沢4720番地

所

の出 願・人

サツポロピール株式会

東京都中央区銀座7丁目10番1号

社

む出 頤 人

株式会社石森製作所

F /7[

東京都大田区東蒲田1丁目23番10号

②代理人 弁理士 平井 信

明 和 世

1. 発明の名称

氧体故证反応效置

2. 特許請求の範囲

3 mm以下の尽みを有する板状の絶縁性誘電体 1 の一面に導電性の電極板2を他面に導電性の相手方電板板3を重合せしめ、

上記電極版2と相手方電極版3とのいずれか一方または双方の絶縁性誘電体1との接触回ញには、 鉄絶縁性誘電体1に接触する接触部4と接触しない非接触節5とで構成した通路6を形成し、

上記電極級2と相手方電機板3との間には交替 質能圧を印加するとともに通路8内に以料気体を 通過せしめるようになした気体放電反応変型。

3. 発明の詳細な説明

『液楽上の利用分野』

本発明は、絶縁性誘電体と電視とによって構成されている気体放電反応装置に関するものである

## 『従来の技術』

現在最も多く利用されている故能反応装置は検 者を放電反応によりオゾン化するオゾン生成装置であり、この技術は、従来は無声故電式と称する、 はで体とこのは定体の一面側に数ミリの問題を持って対数した平行電極板とで構成され、この平行電極板とは定体の反対の面との間に高電圧を印加して誘電体面と平行電極板との空隙に多くの放電を行なう方式のものが知られている。

また、 政近ではセラミック板に面状の電域を埋め込み、この電域と減セラミックの表面にブリント した線状の電極との間に高電圧を印加し、セラミック表面の線状の電極の周囲に深いストリーマ

## 特開昭63-137748 (2)

放電網を作り、気体を減放電器に接触させる領面 放電力式も実用化されている。

「発明が解決しようとする問題点」

しかし、従来のこれら気体故能反応仮置は、耐 名の無声放電方式は比較的荒い放電を繰り返す故 ミリの空間に気体を放すので放電反応時間がかか り、装置が大型高価となる欠点を有していた。

また、後者の前面放電方式は、放電密度は無力 放電に比較して高ことは知られているも、セラミ ・ク表面にプリントした数十ミクロンの検状の電 様周囲に恋起した弱い放電層に気体を接触させる ため、通過気体のうち優かな風だけが接触するこ とになり、高度な反応には過さないという欠点を 打している。

そこで本発明は上記欠点に鑑みなされたもので 、小型の装置で高密度の高効率放電を行なう気体

それ故未発明気体放電反応装置は、電極板2と 相手方型積板3との間に交番高電圧を印加するに 即して、第4例に示すごとく、初めは比較的低電 匠(木実施例では3kv程度)を印加し位々にチ の電圧を高くすると、放電は接触部4の近くで妨 まり、印加電圧を上昇せしめるにつけて放電点は 故後腰部4より違い所に増え、ある縁値(木灾旅 例では12kv)で通路8内は完全に強い放電で 埋められる。この放電は、従来の無声放電とも鉛 面放電とも異なる放電が生じるもので、強いて放 電形態を説明するなら、無声放電域と初前放電域 とが現在する放電であることには相次がないが、 海故は城が連絡・融合することで、接触路4近く に発生した放電街底の裏い沿面放電域が、上方域 、 すなわち非接触部 5 側に拡大せしめられ道路 8 内の故電符度を全体的に見て高器度化するもので

放電反応災器を提供することを目的としたもので ある。

『問題点を解決するための手段』

上記の目的に沿い、先述特許請求の範囲を要旨とする本発明の構成は前述問題点を解決するために、3mm以下の厚みを有する板状の絶縁性誘定体1の一面に尋定性の電積板2を他面に尋定性の和手方電板板3を組合せしめ、上記電積板2と相手方電板板3とのがすれか一方または双方の絶縁性誘電体1との接触面側には、鉄絶縁性誘電体1に接触する接触部4と接触しない非接触部5とで構成した通路6を形成し、上記電積板2と相手方電板板3との間には交番高電圧を印加するとともに通路6内に収料気体を通過せしめるようになした技術的手段を禁じたものである。

F作用』

ある.

そして、この高密度放電を行なう通路B内を原料気体が通過することで、該原料気体は強勢な放電反応が進行するものである。

『災族例』

次に、本発明の実施例を第1図乃至第5図に従って説明すれば以下の通りである。

図中、1が絶縁性誘電体で、この絶縁性誘電体 1 世紀質別般ガラス又は高純度セラミック等の耐 酸性の絶縁性材が使用され3 mm以下の序みを有 する版状に形成されてなる。

そして、上記地級性誘電体1の一面には厚電性の電板版2を、他面には厚電性の相手方電機版3 を組合せしめてある。この電機版2及び相手方電 模板3も射板化材料を使用することが望ましく、 本実施例ではチョン材を使用した。そして、この

特開昭63-137748 (5)

*x* 5 ⊠

